

## ANSPRÜCHE

1. Siebeinheit (19) für eine Druckvorrichtung (2) zum Drucken dreidimensional geformter Strukturen, insbesondere auf Substraten, Leiterplatten, Wafern, Solarzellen, Trägersubstraten,  
5 Drucktischen, Trägerplatten, Sinterplatten oder dergleichen, wobei die Siebeinheit (19) einen zumindest ein Drucksieb (11) tragenden Rahmen (18) aufweist und dazu ausgebildet ist, in einer Siebaufnahme (10) der Druckvorrichtung (2) angeordnet, mit einer Druckmasse befüllt und mit einem Rakel (21) zur Durchführung eines Druckvorgangs beaufschlagt zu werden, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Siebeinheit (19) in oder an dem Rahmen (18) zumindest eine  
10 Halteeinrichtung (20) für das als Wechselrakel ausgebildete Rakel (21) aufweist.
2. Siebeinheit nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Halteeinrichtung (20) eine Rakelaufnahme (24) aufweist, in welcher das Rakel (21) anordenbar ist.
3. Siebeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Rakel (21) einen Halteabschnitt (23) und einen Rakelabschnitt (26) aufweist, wobei die  
15 Halteeinrichtung (20) dazu ausgebildet ist, das Rakel (21) nur an dem Halteabschnitt (23) zu halten.
4. Siebeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das die Halteeinrichtung (20) eine Aussparung (25) aufweist, in welcher der Rakelabschnitt (26) insbesondere berührungsfrei anordenbar ist.
- 20 5. Siebeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Aussparung (25) in dem Rahmen (18) als Vertiefung oder als Durchbruch ausgebildet ist.
6. Siebeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Rakel (21) einen Wechselanschluss (27) für die Druckvorrichtung (2) aufweist.
7. Siebeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass  
25 der Wechselanschluss (27) zumindest ein Rastmittel zum Verrasten des Rakels an einem Druckkopf der Druckvorrichtung aufweist.

8. Drucksystem (1) mit wenigstens einer Druckvorrichtung (2) zum Drucken dreidimensional geformter Strukturen, insbesondere auf Substraten, Leiterplatten, Wafern, Solarzellen, Trägersubstraten, Drucktischen, Trägerplatten, Sinterplatten oder dergleichen, wobei die Druckvorrichtung (2) einen Druckkopf (8), mit einer Rakeleinrichtung (9) aufweist, der ein  
5 Rakel (21) zuordenbar ist und die eine Siebaufnahme (10) zur Aufnahme zumindest einer Siebeinheit (19) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Siebeinheit (19) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ausgebildet ist, und ein Rakel (21) mit einem Wechselanschluss (27) für die Rakeleinrichtung (9) aufweist.
9. Drucksystem nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Rakeleinrichtung (9)  
10 eine Einrichtung (30) zum Entnehmen und Ablegen des Rakels aus der beziehungsweise in die Halteeinrichtung (20) und zum Durchführen eines Druckvorgangs aufweist.
10. Drucksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Vielzahl der Siebeinheiten (19) vorhanden sind.
11. Drucksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**,  
15 dass ein Siebmagazin (3) vorhanden ist, das mehrere Sieblager (14) zur Aufnahme jeweils einer Siebeinheit (19) aufweist, und dass die Siebeinheiten (19) in dem Siebmagazin (3) gelagert sind.
12. Drucksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Siebmagazin (3) eine Konditionierungseinrichtung (23) zum Einstellen oder Aufrechterhalten eines Klimas in dem Siebmagazin (3) aufweist, durch welches ein Eintrocknen  
20 von auf einer Siebeinheit (19) zurückgebliebener Druckmasse verhindert ist.
13. Drucksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Transporteinrichtung (4) vorhanden ist, die dazu ausgebildet ist, eine ausgewählte Siebeinheit (19) aus dem Siebmagazin (3) zu entnehmen und in der Siebaufnahme (10) der Druckvorrichtung (2) anzuordnen und umgekehrt.